

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載
 【部門区分】第 5 部門第 2 区分
 【発行日】平成 18 年 2 月 2 日 (2006.2.2)

【公表番号】特表 2005-511975 (P2005-511975A)
 【公表日】平成 17 年 4 月 28 日 (2005.4.28)
 【年通号数】公開・登録公報 2005-017
 【出願番号】特願 2003-549059 (P2003-549059)
 【国際特許分類】

F 1 6 K 31/08 (2006.01)

【F I】

F 1 6 K 31/08

【手続補正書】

【提出日】平成 17 年 12 月 5 日 (2005.12.5)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

シャッター手段を位置決めするために用いられる磁気装置 (2) の位置決め素子であって、

該磁気装置 (2) は、該磁気装置が強磁性シャッター支持体 (7) に接触している使用位置と、該磁気装置が該シャッター支持体から離間している非使用位置の間を移動可能であり、

該位置決め素子は、該磁気装置の保持力に抗して該磁気装置を支持する少なくとも一つの保持デバイス (12) を含むとともに、前記保持力に抗して持ち上げ力を発生して該磁気装置を前記非使用位置に保持する少なくとも一つの弾性支持ユニット (13) を含んでおり、

前記磁気装置は前記保持デバイスに堅固に結合され、

前記支持ユニットは、少なくとも該磁気装置が非使用位置にあるときは、少なくとも前記保持デバイスの一部に沿って、前記保持デバイスと前記シャッター支持体の間に配置されていることを特徴とする位置決め素子。

【請求項 2】

少なくとも二つの互いに離間した前記保持デバイスを備え、該各保持デバイスが一つの前記支持ユニットに関与することを特徴とする請求項 1 記載の位置決め素子。

【請求項 3】

前記磁気装置を使用位置から非使用位置まで移動させるためのリフトオフ手段 (3) が備えられていることを特徴とする請求項 1 又は 2 記載の位置決め素子。

【請求項 4】

前記リフトオフ手段が前記磁気装置に取り付けられていることを特徴とする請求項 3 記載の位置決め素子。

【請求項 5】

前記リフトオフ手段は、前記シャッター支持体に係合する偏心輪 (10) を備えており、これにより、前記磁気装置を使用位置から非使用位置まで移動させることを特徴とする請求項 3 又は 4 記載の位置決め素子。

【請求項 6】

前記リフトオフ手段を操作するためのレバーが備えられていることを特徴とする請求項

3乃至請求項5のうちいずれか1項記載の位置決め素子。

【請求項7】

前記レバーと前記偏心輪は互いに堅固に結合されて、前記磁気装置上に回転可能に支持されていることを特徴とする請求項6記載の位置決め素子。

【請求項8】

前記偏心輪は、前記磁気装置の一つの側面の向かい側にある側面よりも該一つの側面の近くに位置するように配置されていることを特徴とする請求項5乃至請求項7のうちいずれか1項記載の位置決め素子。

【請求項9】

前記支持ユニット(13)は、持ち上げ力を発生する弾性スプリング要素(18)を備えていることを特徴とする請求項1乃至請求項8のうちいずれか1項記載の位置決め素子。

【請求項10】

前記弾性スプリング要素が圧縮ばねであることを特徴とする請求項9記載の位置決め素子。

【請求項11】

前記支持ユニットはレストオン手段(14)を備えており、該レストオン手段は前記保持デバイス内に変位可能に支持されるとともに、少なくとも前記磁気装置が非使用位置にあるときは前記シャッター支持体(7)の上に載り、該レストオン手段と前記保持デバイスの間にスプリング手段が収容されることを特徴とする請求項9又は10記載の位置決め素子。

【請求項12】

前記レストオン手段は実質的にポット形状を有しており、前記保持デバイスの前記応接手段はシリンダージャケットの形状を有することを特徴とする請求項11記載の位置決め素子。

【請求項13】

前記レストオン手段は前記保持デバイスに専属的に結合されていることを特徴とする請求項11又は12記載の位置決め素子。

【請求項14】

前記スプリング手段のばね力は調節可能であることを特徴とする請求項11乃至請求項13のうちいずれか1項記載の位置決め素子。

【請求項15】

前記ばね力を調節するための調節ねじが設けられていることを特徴とする請求項14記載の位置決め素子。

【請求項16】

前記保持デバイスが前記磁気装置内に統合されていることを特徴とする請求項1乃至請求項15のうちいずれか1項記載の位置決め素子。

【請求項17】

前記保持デバイスが前記磁気装置内に孔により形成されていることを特徴とする請求項1乃至請求項16のうちいずれか1項記載の位置決め素子。

【請求項18】

磁気装置と請求項1乃至請求項17のうちいずれか1項記載の位置決め素子を含むことを特徴とする組み立てセット。

【請求項19】

請求項1乃至請求項17のうちいずれか1項記載の位置決め素子を含むことを特徴とするシャッター手段。

【請求項20】

前記シャッター手段と前記保持デバイスが一体に形成されていることを特徴とする請求項19記載のシャッター手段。